電界効果磁気スキルミオントランジスタの作製とその特性

馬闖¹,荒井遼真¹,張渓超¹,山田侑生¹,森迫昭光¹,劉小晰¹,小野輝男² (¹信州大学、²京都大学)

Preparation and properties of field-effect magnetic skyrmion transistor

Chuang Ma¹, Ryoma Arai¹, Xichao Zhang¹, Yusei Yamada¹, Akimitsu Morisako¹, Xiaoxi Liu¹, Teruo Ono²,

(¹Shinshu Univrtsity, ²Kyoto University)

はじめに

磁気スキルミオンはトポロジカル準粒子とみなすスピンの特殊な渦巻き構造である。その小ささと不揮発 性、可制御性から次世代不揮発性論理回路への応用を考えられる。本研究では、チャネルに電界を印加可能 な3端子構造を作製し、電界アシスタント磁気スキルミオンの生成、電流駆動磁気スキルミオンの閾値電流 密度とそのゲート電圧の影響、電界効果磁気スキルミオントランジスタとしての動作を報告する。

実験方法

試料作製には、ステンシルリソグラフィー法、フォトリソグラフィー法と スパッタリング装置を用いて、Fig. 1 に示すような 3 端子構造を作製した。 チャネルは幅 4 μ m,長さ約 20 μ m の Pt (0.5 nm)/CoNi (0.4 nm) /Pt (0.5 nm)/CoNi (0.4m)/Pt (1 nm)の多層構造と構成された。

作製した素子はレーザーマイクロカー測定装置を用いて電界印加時の磁 気特性を測定した。更に、高分解能カー顕微鏡による電界電流印加時の磁区 構造と電界印加時の磁壁移動速度を測定した。



Fig.1 Structure of the device.

実験結果

and $V_G = 8 V_c$

Fig. 2 にチャネル部にゲート電圧 V_G=0 V と V_G=8.5 V の磁気特性を示す。V_G=0 V 時は優れた垂直磁気異 方性を示し、保磁力 H_cが約 30 Oe であった。しかし、V_G=8.5 V 印加すると磁気特性に大きな変化が見られ、 試料の垂直磁気異方性が減少し、保磁力も約 2 Oe まで減少した。Fig. 3 にチャネル部のカー顕微鏡によって 観察した磁区構造の一例を示す。電流駆動時に、ゲート電圧アシスタントによって磁気スキルミオンバブル が形成したと考えられる。Fig. 4 に V_G=0 V から V_G=8.5 V まで増加させた時に電流駆動磁気バブル移動の閾 値電流密度 J_cの結果を示す。V_G=0 V の時の Jc が約 5.9 x 10¹¹ (A/m²)であったが、V_Gの増加に伴い Jc が減少 し、V_G=8.5 V の時に J_cが約 5.1 x 10¹¹ (A/m²)まで減少した。ゲート電圧印加によってチャネル部の閾値電流 密度の制御を実現した。電流一定の時、電界による磁気スキルミオンの電流駆動の"ON"と"OFF"の確認もで きた。



as a function of gate voltage V_{G} .